UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1 ...

FACULTAD DE QUIMICA

TITULO DEL TEMA

DESARROLLO DE UN BAÑO ELECTROLITICO DE CROMO NEGRO PARA EL DEPOSITO DE SUPERFICIES SELECTIVAS

NOMBRE DEL SUSTENTANTE

ARTURO FERNANDEZ MADRIGAL

CARRERA

INGENIERO QUIMICO

Año

1980

M-19107



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. PRESIDENTE ENRIQUE VILLAREAL DOMINGUEZ

VOCAL SILVA LILIA TEJADA CASTANEDA

Jurado asignado originalmente SECRETARIO DOMINGO ALARCON ORTIZ segun el tema

1er.SUPLENTE MA. MAGDALENA ALVAREZ RUIZ

2do.SUPLENTE YOLANDA FRIAS RUIZ

Sitio donde se desarrolló el tema: ______INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MATERIALES.

Nombre completo y firma del sustentante:________ARTURO FERNANDEZ MADRIGAL

Nombre completo y firma del asesor del tema:

ING DOMINGO ALARCON ORTIZ

Nombre completo y firma del supervisor técnico:

DR. LUIS DEL CASTILLO MORA



	CONTENIDO	
		PAG.
	OBJET I VO	5
	INTRODUCCION	6
	CAPITULO I SUPERFICIES SELECTIVAS	
	I.1 Principios teóricos	9
	I.2 Características de las superficies	
	selectivas	14
	I.3 Métodos de medida de α y ϵ	17
	I.4 Diferentes tipos de superficies se-	
	lectivas	20
	CAPITULO II CROMO REGRO	
	II.1 Diferentes baños para la obtención	
	de cromo negro	28
	II.2 Estructuras propuestas para el cro-	
	mo negro	36
	II.3 Hipótesis sobre el mecanismo de for-	
	mación	42
	CAPITULO III EXPERIMENTACION	
	III.1 Estudio del baño propuesto	50
·	• 111,2 Condiciones de operación	52
	III.2.1 Densidad de corriente	52
	III.2.2 Temperatura	54

· - 3 -

III.2.3 Concnetración del cataliza

dor	55
111.3 El sustrato y su tratamiento	56
III,4 Relación ánodo/catódo	58
III.5 Distancia entre electrodos	58
III.6 Relación CrO ₃ /Na ₂ SiF ₆	58
III.7 Medición de propiedades ópticas	59
CAPITULO IV RESUITADOS	
IV.1 Influencia de los parámetros de pro-	
ceso en a y ε.	62
IV.2 Variación de α y ε como función de	•
ју 0.	67
CONCLUSIONES	76
BIBLIOGRAFIA	77

\$

- 4 -

O B J E T I V O .

El objetivo de este trabajo es proponer un baño electrolítico para la preparación de cromo negro.

Este recubrimiento depositado sobre sustratos metálicos y en particular sobre cobre presentan propiedades tales que pueden ser usadas como superficies selectivas.

Las superficies selectivas juegan un papel muy impor-

tante en el diseño de colectores solares de alta temperatura.

- 5 -

INTRODUCCION

Tomando en cuenta la características de insolación(33, 34) con que cuenta nuestro país, el uso de la energía solar resulta muy adecuado. Considerando que el promedio diario de ener gía solar recibida en el transcurso del año es 5.5 Kwh/m²dia, se tiene que para la extensión territorial nacional de 1 972 -547 Km², la energía solar recibida diariamente sobre todo el país es aproximadamente 10.85 x 10^{12} Kwh, o sea, 39.59 x 10^{14} Kwh-año. Comparando esta cantidad con la que anualmente incide sobre los Estados Unidos de Norteamerica equivalente a 9.0 x 10^{14} Kwh-año, México recibe un 44% más de esta cantidad, no ob<u>s</u> tante que se cuenta tan solo con la quinta parte de extensión territorial,

De acuerdo a las aplicaciones que han surguido en el uso de la energía solar se han dividido en dos grandes grupos llamados conversión fotovoltáica y conversión fototermica.

De manera general la conversión fotovoltáica depende fundamentalmente de las propiedades electrónicas del material, así como de las ópticas. Y en el caso de la fototérmica se encuentran involucradas las propiedades tanto térmicas como ópticas de la estructura de la superficie.

Nuestro interés se enfoca en la conversión fototérmica que ha encontrado diversas aplicaciones, que abarcan principalmente el calentamiento de agua y su uso extensivo en la refigeración, secado de granos, climatización, etc.. Para ello se debe contar con superficies de captación que presenten se-

- 6 -

lectividad en la absorción de la radiación electromagnética. Esto conduce a definir el concepto de superficie selectiva la cual se interpreta como aquella que presenta una alta absotividad en la región del visible y cercano infrarojo (0.3-2.5 μm) y una baja emisividad en el medio y lejano infrarojo (2.5-20 μm).

La superficie de captación a la que tradicionalmente se ha recurrido es el cuerpo negro, el cual no presenta caract<u>e</u> rísticas de selectividad, en cambio superficies como el Cromo Negro si proporciona esta selectividad ($\alpha \simeq 0.9$ y $\epsilon \simeq 0.1$).

Las caracterízticas de este tipo de superficies produce una disminución en las pérdidas por radiación, con lo cual es posible alcanzar temperaturas mas elevadas en comparación con los cuerpos negros (fig.1).

La forma de lograr valores bajos en ε y altos en α depende del tipo de superficie, asi como de los parámetros que se involucran en su preparación. Existen diferentes técnicas para su obtención entre las cuales encontramos al ele<u>c</u> trodepósito. El Cromo Negro es una S.S. que puede ser obten<u>i</u> da mediante este método. Su uso se ha extendido enormemente dada su estabilidad hasta temperaturas del orden de los 300[°]C.

Sin embargo existen diversos problemas para su obtención como son el empleo de altas densidades de corriente($j>20 \ \Lambda/dm^2$) y el uso de una adecuada concentración del catalizador.

En este trabajo se presenta un nuevo baño para la obte<u>n</u> ción de Cromo Negro y un estudio sistemático de los parámetros

- 7 -

que influyen en su preparación, asi como resultados de las propiedades ópticas para diversas condiciones.



Fig. 1 Variación de la temperatura con el tiempo, durante el calentamiento y el enfriamiento de un cuerpo negro y una superficie selectiva.

- 8 -

CAPITULO I

9

SUPERFICIES SELECTIVAS

I.1 Principios teóricos.

La radiación solar que se encuentra distribuida a lo largo de un espectro de longitudes de onda, incide sobre cuerpos colectores en los cuales provoca cambios en los estados energéticos de los electrones, tales como rotacionales, vibracionales, etc., de los átomos que constituyen dichos cuerpos.

Las longitudes de onda importantes en energía solar y sus aplicaciones se encuentra en un intervalo que ya desde 0.2 µm hasta 25 µm.

La cantidad de energia radiante emitida por un cuerpo en todas las longitudes de onda, por unidad de área y de tiempo, es la potencia total E (Cal/h-m²). Si la intensidad de la ene<u>r</u> gia radiante a cualquier longitud de onda es I(Cal/h-m²), la potencia total es el área bajo la curva y puede ser calculada por:

 $E = \int_0^{\infty} I_{\lambda} d\lambda \qquad \dots \qquad I.1.1$

Planck fué el primero en reconocer la naturaleza de la energía radiante y desarrolló una ecuación que se adapta a la curva de energía espectral a cualquier temperatura esta dada por:

$$I_{\lambda} = c_1 \lambda^{-5} / e^{c_2 / \lambda T} = 1 \dots 1.1.2$$

donde:

 I_{λ} - Intensidad monocromática en (Cal/h-m²)

c₁ y c₂ ~ Constantes con valores de respectivamente.

T - Temperatura en ^{O}K λ - Longitud de onda (jm)

Como consecuencia Wien postuló una ley denominada Ley del desplazamiento de Wien, la cual establece que el producto de la longitud de onda del valor máxima de la intensidad monocromática de emisión y la temperatura es una constante;

 $\mu T = 2884 \ \mu m$... I.1.3

Las determinaciones espectrales de la radiaciones rec<u>i</u> bidas por la superficie de la tierra desde el sol y tomando en cuenta la absorción por la âtmosfera, indica que el máximo de I_{λ} esta aproximadamente a los 0.25 µm.Haciendo un balance de π energía respecto a un receptor, la energía total que incide; tenemos que;

 $\alpha + \rho + \tau = 1$... 1.1.4

donde:

α - fraccióm absorbida

ρ - fracción reflejada

 τ - fracción transmitida

Kirchhoff introdújo que la razón de la potencia emisiva total a la absorbancia para todos los cuerpos es la misma, p<u>a</u> ra una longuitud de onda dada. Es decir que al colocar un cue<u>r</u> po de un tamaño determinado dentro de una esfera a la que pr<u>e</u> viamente se le realizó el vacío, ambos, cuerpo y esfera, después de un determinado tiempo llegaran al equilibrio, y si eso cuerpo es negro (que por definición tiene absorbancia de uno), tendremos que por balance de calor:

 $\alpha = \varepsilon \qquad \dots \mathbb{I}.1.5$

Entonces la razón de la intensidad real a la potencia emisiva del cuerpo, bajo idénticas condiciones, se llama emi sividad ε , dado que la referencia es la emisividad de un cue<u>r</u> po negro con valor de 1.0.

Lo que nos conduce a decir que para una superficie no transparente, la transmitancia es nula, con lo que asi tenemos:

$$\alpha + \rho = 1 \dots 1.1.6$$

Entonces el valor de la emitancia:

$$\epsilon_{1} = \alpha_{1} = 1 - \rho_{1} \dots I \dots I \dots I$$

Mediante la ley de Planck podemos determinar la radiación total y asi de las ecuaciones I.1.1 y I.1.2 ;

 $E_{b} = 0.173 \times 10^{-8} T^{4} \dots I.1.8$

donde:

E_b = Potencia emisiva de un cuerpo negro.

T - Temperatura absoluta ($^{\circ}$ K).

La que establece que la radiación total de un cuerpo negro perfecto es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta.

Ahora bien si no es un cuerpo negro la razón de la emisividad $E/E_{\rm b}$ puede escribirse como $E = E_{\rm b} \epsilon$.

Y con ayuda de la ecuación 1.1.8 se tiero:

 $H = c_{\sigma} T 4 \dots I.1.9$

 $\sigma = 0.073 \times 10^{-8}$ constante de

12 -

Stefan-Boltzmann

Entonces cuando una superficie emite, tambien absorbe y es por lo que la pérdida de radiación neta esta en función de la emitancia efectiva ε_c y no de ε , puesto que se tiene la co<u>n</u> tribución de los alrededores que reflejan algo de esta radiación, asi tenemos:

$$q_r = \epsilon_c \sigma (T^4 - T_s^4)$$

donde:

q_r - Pérdida de radiación por unidad de área.

T - Temperatura de la superficie
 T_s - Temperatura de los alrededores
 σ - Constante de Stefan-Boltzmann

I.2 Características de las superfiices selectivas.

Los requerimientos básicos para una superficie selectiva empleada para colectores solares son las siguientes:

a) Alta absortividad α

- b) Baja emisividad ε
- c) Estabilidad térmica a la temperatura de operación.

d) Reproducibilidad

- e) Estabilidad a la corrosión atmosférica
- f) Costo razonablemente bajo.

De estas características las mas importantes son las que se refieren a las propiedades ópticas (α y ϵ).

Una superficie selectiva ideal es aquella que presenta un comportamiento como el mostrado en la Fig.I.2.1.





En esta figura observamos que la reflectividad ρ es cero hasta un valor critíco de λ , denominado λ_c , en donde se presenta un escalón espectral, mientras que la reflectivida adquiera un valor de 1

De acuerdo a la Ley de Kirchhoff la reflectividad se relaciona directamente con los valores de α y ε . Siendo una medida adecuada de la selectividad aquella que considera una relación entre la absortancia para la radiación solar dividia entre la emitancia para el infrarojo a la temperatura que opera la superficie selectiva.

La absortividad y la emisividad total se determinan por la int<u>e</u> gración en todo el espectro electromagnético, como se muestra en las ecuaciones I.1.1 y I.1.2 .

$$\alpha = \frac{\int_{0}^{\infty} (\lambda, T) E^{S}(\lambda) d \lambda}{\int_{0}^{\infty} E^{S}(\lambda) d \lambda} \dots I.1.1$$
$$\varepsilon = \frac{\int_{0}^{\infty} \varepsilon (\lambda, T) M^{O}(\lambda, T) d\lambda}{\int_{0}^{\infty} M^{O}(\lambda, T) d\lambda} \dots I.1.2$$

Debido a que la operación de los colectores solares involucra el uso tanto de la radiación directa como difusa debe de conocerse la reflectividad hemisférica. Dicha reflectividad varia según el angulo de incidencia, debido a lo cual deberan hacerse correcciones a los valores de α y ε , separando las diferentes contribuciones en la intensidad y el angulo de incidencia a lo largo de un dia,mes o año.Bajo estas co<u>n</u> diciones la ecuacion I.1.1 queda :

- 15 -

$$\alpha(t) = \frac{\int_{0}^{\infty} \alpha^{r}(\Theta, \gamma, \lambda, T) E^{S}(\Theta, \gamma, \lambda, t) \cos\Theta d d\lambda}{\int_{0}^{\infty} E^{S}(\Theta, \gamma, \lambda, t) \cos\Theta d d\lambda}$$
 I.1.3

Donde $E^{S}(\Theta, \gamma, \lambda, t) = E_{b}^{S}(\Theta, \gamma, \lambda, t) + E_{d}^{S}(\Theta, \gamma, \lambda, t)$ es la suma de los componentes de la radiación directa y difusa en la dirección (Θ, γ) a un tiempo t. Esto hace definir un valor medio de α por integración bajo el tiempo:

$$\alpha = 1/t_0 \int_0^{\infty} \alpha(t) dt$$

A continuación se muestra una representación esquematica de los parametros de reflectividad:



Fig. I.2.1 Representación esquematica de los parametros de reflectividad.

- 16 -

I.3 Métodos de medida α y ε .

Los métodos existentes para la evaluación de las propiedades ópticas de una superficie se clasifican en dos grandes grupo que son: Métodos ópticos y Métodos térmicos.

Los métodos ópticos recurren a la medida de la radiación reflejada o emitida por un material. Así tenemos que para la medida de la radiación reflejada se utilizan espectrofotómetros de doble haz como por ejemplo el mostrado en la Fig. I.3.1. Además esta medida puede o<u>b</u> tnerse también con una combinación fuente-detector en el cual la fuente proporciona una respuesta aproximadamente igual al espectro solar.

Las medidas de radiación emitida pueden evaluarse con dispositivos tales como las termopilas.



Fig.I.3.1 Diagrama esquemático de un espectrofotómetro de doble haz.

En los métodos térmicos, la medida de α y ε se basa principalmente en la evaluación de la rapidez de cambio de la temperatura en el mate rial. Al cual se le incide una radiación mediante dispositivos tales como una lampara de Xenón. Este material se encuentra suspendido en una camara a la cual se le realiza previamente un vacío.

- 17 -

Una descripción mas detallada de la clasificación de estos métodos se encuentra resumida en la Tabla I.3.1.

TABLA I.3.1

A. METODOS OPTICOS

- 1) Médida de la Reflectividad
 - a) Resolución espectral
 - (1) 0.3-2.5 μ m para α
 - (2) 5.0-35.0 μm para ε

b) Integrado

(1) Fuente de luz-Resis tencia-Detector aproximado al espec-

tro solar, para ε

 (2) Fuente-Detector de respuesta, simulando un cuerpo negro a 3υ0⁰R para ε

2) Medidas de radiación emitida, solamente para

a) Resolución espectral

(1) 5-35 µm

b) Integrado

B. METODOS TERMICOS

- 1) Medidas de equilibrio
 - a) Con calentamiento electrico, para ε
 - b) Con simulador solar como calentador, para α y ε .
 - c) Con simulador solar para α (Calorimetro de agua).

2) Medidas dinamicas

a) Con simulador solar como calentador, para α y ε.
b) Enfriamiento adiabatico,

para e

I.4 Diferentes tipos de superficies selectivas.

Se ha clasificado a las diferentes superficies selectivas de a-cuerdo a su comportamiento cuando interaccionan con la radiación electromagnética.

A continuación se presenta una clasificación en base a dicho com portamiento:

1.- Superficies metálicas recubiertas con una estructura metálica muy fina, las cuales poseen una emisividad inherentemente pequeña y pu<u>e</u> den tener una alta absortividad.

A este primer grupo pertenecen todas aquellas superficies en las que se ha depositado metal finamente dividido proporcionandole con ello una alta absorción del flujo solar, debido a las multiples reflexiones producidas por las particulas metálicas.

El tamaño de estas particulas permite que la capa sea transparente al infrarojo y por lo tanto la emisividad es la correspondiente al sustrato.

Ejemplos representativos de este tipo de superficies se encuentran resumidos en la tabla I.4.1.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Superficie	α.	ε e	cmp. de stabilidad	Estru	ctura	
Tugsteno dentritico	0.99	0.26	550 ⁰ C	dentr	itico	alineado
Aluminio-Acero	0.99	0.55	26 "	11	* *	esparcido

TABLA I.4.1

•	cont.	TABLA 1.4	. 1	
Superficie	α.	ε	Temp. de estabilida	d Estructura
Aluminio-Acero314	0.89	0.47	27 ⁰ C	dentritico esparcido
Aluminio-Niquel	0.94	0.3	26 ^m	cavidades porosas
Aluminio4022-Nique1	0.97	0.21	26 ''	11 11 11
Aluminio-Acero430	0.98	0.51	26 ''	dentritico esparcido
Niquel dentritico	0.95	0.6	100 "	redondas alineadas
Aluminio	0.95	0.71	10.0 ''	dentritico
				•••••

1a).- Como parte de esta clasificasión encontramos que arreglos como
 ABSOBEDOR-REFLECTOR, denominados tambien "Espejos Calientes" presentan
 un comportamiento como el descrito anteriormente.

Este tipo de configuraciones o arrglos (Fig.I 4.1) estan constituidos por un materialque es altamente reflectivo en el infrarojo, y el cual se deposita sobre un absorbedor negro no selectivo.

Como ejemplos de este tipo podemos mencionar a las capas de óxido de Estaño, óxido de Indio o mezclas de ambos (esta mezcla configura la capa ITO) utilizadas como reflectores selectivos y el empleo del silicio como Absorbedor.



Fig. I.4.1 Configuración de un apilamiento Absorbedor-Reflector(Espejo Caliente)

La Fig. I.4.2 compara la reflectividad de un arreglo ITO-silicio

- 21 -



0.9

0.5

0.7

C

LONGITUD DE ONDA Hm Reflectividad espectral especular de: a) silicio, Fig. I.4.2 b) y c) silicio con un espesor de 0.79 µm mediente rociado de óxido de estaño-indio.

2

3

9

10

Las capas ITO son estables a temperaturas mayores de 300°C. Estas se adhieren bien al vidrio y resisten ataques quimicos.

2.- El segundo tipo denominado comunmente como "Espejos Negros" pre senta la siguiente configuración:



F.g. I.4.3 Configuración para los "espejos Negros".

Estas superficies que constan de una capa negra depositada sobre

- 22_ -

un sustrato metálico de baja emisividad (ϵ). El depósito ademas posee una alta absortividad en la región del visible y cercano infrarojo (0.3-2.5 m) siendo transparente a longuitudes de onda largas.

La manufactura de estas superficies puede realizarse por cambios químicos o morfológicos de una superficie metálica.

Muchos de los semiconductores naturales son candidatos potenciales para estos absorbedores selectivos. La acción óptica de estas capas resulta de la combinación de los efectos debido a la absorción intrinseca de los semiconductores como tambien al índice de refracción y a la textura superficial.

A continuación se mencionan algunas superficies selectivas de este tipo:

Superficie	¢	ε	Técnica de fabricación	Autor
Oxido de cobre sobre niquel	0.81	0.17	Oxidación de un electrodo de Cobre	Kokoropouls (1959)
CuO sobre Al	0.93	0.11	Rociado de una solución de Cu(NO ₃) ₂ sobre Al	Hottlel y Unger(1959)
CuO	0.89	0.17	Tratamiento qu <u>i</u> mico con NaOH y NaClO ₂	Close (1962)
Oxidos de Cu sobre Cu	0.90	-0.16	Tratamiento de cobre enegrecido	Edwards (1960)
Pb2S sobre Al	0.89	0.20		Williams (1963)

TABLA I.4.2

- 23 _

	1		·	
Superficie	α.	٤	Técnica de fabricación	Autor
Niquel Negro sobre Fe galv.	0.91	0.11	Electrodepósito de un complejo Ni-Zn-Sulfuro	Tabor (1964)
Niquel Negro sobre Ni pulido	0.89	0.12	17. 1 1 11	11 11
CuO sobre Al Anodizado	0.85	0.11	Tratamiento qui mico sobre Al ano- dizado con Cu(NO ₃ ;) ₂
			- KMnO ₄ .	-
MnO sobre Al	0.87	0.29	Trat. quim. con KNnO ₄ (5-20 g/1)	Ref. 8
Niquel Negro	0.94	0.07	Electrodepósito de 2 capas de Ni sobre sobre acero suave	e Schmidt (1974)
Cu ₂ S	0.79	0.20	Conversion Quim.	Mattrox
Cromo Negro CrO _x -Cr	0.95	0.1	Electrodepósito sobre Cu	Mc Donald (1977)_
Cr ₂ 0 ₃ +Cr	0.92	0.08	Rociado .	Fan y Spura (1977)
•			· · · · · · · · · · · · ·	•••••

cont. TABLA I.4.2

3).- El tercer tipo de superficies corresponde a las capas de interferencia óptica. En ellas el efecto que se produce es el resultado neto de la multiplicidad de pasos de la radiación electromagnetica atraves del dieléctrico que se encuentra entre dos superficies reflectoras.

Estos arreglos de interferencia selectiva se logran mediante un -

metal como sustrato lo suficientemente pulido, debido a lo cual la reflectividad aumenta considerablemente desde el visible hasta el infrarojo. También un calentamiento previo produce el mismo efecto.

Un arreglo para cuatro capas de interferencia se muestra en la -Fig. I.4.4 FLUJO SOLAR <u>ICAPA DIELECTRICA2</u> <u>ICAPA DIELECTRICA2</u> CAPA DE METAL TRANSPARENTE <u>ICAPA DIELECTRICA1</u> CAPA REFLECTIVA DE METAL SUSTRATO DE AGERO INOXIDABLE FIG. I.4.4

El comportamiento de estas capas con respecto a la reflectividad se muestra en la Fig. I.4.5



Fig. I.4.5 Reflectividad espectral especular para cuatro capas.

De esta figura se puede observar un comportamiento de la reflectividad semejante al de una superficie selectiva ideal.

En la tabla I.4.3 se encuentran algunos ejemplos de estas capas de interferencia.

Superficie	α	E	Técnica de obtención	Autor
-Mo-A1203-Mo-A1203	0.91	0.085	Aspersión	Schmidt (1964)
A1203-Ag-A1203-Ag	0.75	0.085	11 11	Mc Kenney (1979)
A1 ₂ 0 ₃ -Cu-A1 ₂ 0 ₃ -Cu	0.80	0.08	tt th	11 11
Ag-A1 ₂ 0 ₃ -Cr-A1 ₂ 0 ₃	0.95	0.04	It II	Mainel (1976)

TABLA I.4.3

El empleo de bases tales como Ni,Fe,Sn,Ti,Au, Al, y carburos metálicos, y como capas dielectricas al MgF_2 , SiO_2 , CeO_2 , han sido tambien objeto de estudio. En forma general el empleo de métodos como la -Evaporación y Aspersión son los mas utilizados para la elaboración de estas capas de interferencia.

La clasificación anterior se basa, como se señaló, en la interacción que sufre la S.S. con la radiación electromagnética. Sin embargo en la utilización práctica de estas superficies, se puede subclasificar según la temperatura de operación. Asi tenemos que para bajas temperaturas $(150-300^{\circ}C)$ se usan recubrimientos selectivos tales como: Níquel Negro, Cromo Negro, etc.

Para temperaturas superiores a los 500⁰C, la obtención de supe<u>r</u> ficies como el "Oro Negro" resulta ser adecuada.

/lgunos ejemplos representativos de estas superficies se encuentran en la tabla I.4.4

Superficie	α	• E	T(^O C) de estabilì- dad.	Técnica de obten cioón.	Autor
Oro Negro: con espesor de					
0.81g/m ²	0.88	0.1	400	Evaporación de oro a partir de una fuente Tugsteno.	Ref.(6)
0.89 "	0.75	0.07	τι	11 11 ,	11
^{Co} 3 ^O 4 sobre sustratos de Ag,Ni,Pt .	0.9	0.3	1000	Oxidación termica	Ref.(2)
Cr ₂ 0 ₃ +Co	0.9	0.5	800	Aspersión	Ref(35)
WC + Co	0.95	0.28	11	11 11	,,
Sio-Cr-Sio	0.88	0.1	450	Evaporación al vacio	**

TABLA I.4.4

CAPITULO II.

CROMO NEGRO

II.1 Diferentes baños para la obtención de Cromo Negro.

El cromo negro es probablemente el ejemplo más tipico de recubrimientos selectivos que ya se encuentra a nivel comercial. Sus propiedades ópticas aún en depositos en superficies grandes, son muy aceptables ($\alpha \simeq 0.9$ y $\epsilon \simeq 0.1$).

No obstante, tanto el mecanismo de electrodepósito como la morfologia no son hasta el momento bien conocidas. Un mejor conocimiento de estos parámetros permitira entender por lo menos cualitativamente el f<u>e</u> nómeno de absorción de la radiación electromagnética.Cabe señalar que el uso de esta S.S. esta limitado a temperaturas hasta de 300° C.Esto probablemente es debido a la oxidación de cromo metálico que contiene su microestructura; que es la responsable de las propiedades ópticas.

Se cuenta con dos métodos diferentes para la elaboración de este tipo de S.S., tales como el electrodepósito y la evaporación al vacio.

El empleo del cromo negro como absorbedor solar selectivo fue ini cialmente propuesto por G.Mc Donald usando como método de obtención al electrodepósito, en el cual tanto la composición como las características del baño juegan un papel muy importante tanto en la calidad como en la uniformidad de los electrodepósitos obtenidos.

En la siguiente sección se presenta las principales características de los métodos de elaboración.

- 28 -

ELECTRODEPOSITO.

Mc Donald (9) mediante un electrodepósito con una solución de HARSHAW CHROMONYX realizó deposito de croro no gro. Utilizando al acero y alurinio coro sustratos, realizandoles un niquelado previo. Los resulatados en arbos casos fueron s<u>i</u> milares.

La importancia fundarental de dicho trabajo es la comparación que hace entre croro negro, niquel negro y pintura -0.28 negra, coro lo muestra la Fig. II, 1.1 (a y b).





Fig. II.1.1 (a y b) Reflectividad del cromo negro(I), niquel negro(I y II) y pintunegro, en funció de λ .

En la Fi ξ , II, 1, 1 (b) se observa que el niquel ne ξ ro y el croro ne ξ ro presentan diferentes λ_c . Además las curvas 2 y 3 correspondientes a niquel ne ξ ro ruestran un desplazariento de λ_c , esta tendencia indica que las variables de forración de la capa son más significativas que la diferencia inherentes en

- 29 _

tre el cromo y niquel negro.

La tabla II.1.1 muestra los coeficientes de absortividad (α) y emisividad (ϵ) globales.

Superficie	α (AM-2)	ε (3-15µm) [
	· • · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·	•
Cromo Negro-1	0.868	0.088	
Niquel Negro-2	0.877	0.066	
Niquel Negro-3	0.867	0.109	-
Pintura Negra (3M-NEXTEL)	0.967	0.967	ta a set e e

TABLA II.1.1

⁺Basado en el espectro de un cuerpo negro a 100° C.

Las medidas de reflectividad indican que tanto el níquel negro como el cromo negro presentan propiedades selectivas similares, lo que es altamente significativo debido a la factibilidad economica de este último.

Una de las particularidades del CHROMONYX(14) es el con tenido de Ba⁺², el cual precipita al ión sulfato(16). Otra característica de esta solución es el contenido de Cr^{+3} que permite la obtención de depósitos uniformes de cromo negro,cuando se usa al niquel como ánodo.

Otro de los baños clásicos es el propuesto por B. Window y coautores(11), quienes realizaron muestras sobre sustratos de cobre pulído, depositando una capa de niquel mediante el baño de Weisberg.

Las condiciones de operación fueron las siguientes: j=200 mA/cm², a una temperatura de 23⁰C, usando anodos de plomo.

Dichos autores observarón la existencia de tres zonas, las cuales clasificaron según el tiempo de electrodepósito(11) asi se tiene que; de 20 a 50 seg. las muestras son especulares con interferencia de colores tipicos de capas dielécticas. De 50 a 60 seg. dichas muestras son no especulares y grises; y p<u>a</u> ra tiempos de electrodepósito arriba de los 60 seg., son especulares y negras. Ademas algunas capas presentarón las tres r<u>e</u> giones; en el centro la capa dieléctrica, la capa negra en los bordes y la gris entre ambas









31 -

Como se observa de la Fig. II.1.2, el cambio en la emisividad para un tiempo de electrolisis de 55 seg. corresponde una caida brusca en el peso y para la cual no se tiene una explicación. A este punto corresponden los mejores valores de α y ε (ver Fig. II.1.2 y Fig. II.1.3).

La Fig. II.1.4 muestra que para las placas depositadas a 50,55,60,65,70 y 80 seg., la absortividad varia con respecto a la longuitud de onda, y esto es una característica de las capas de interferencia. Para tiempos mayores el fenómeno desapar<u>e</u> ce.



Fig. II.1.4 Variación de la reflectividad en función de la longitud de onda, para tiempos de electrolisis (0,50,55,60,65,70 y 80 seg) constantes.

32_

Un estudio reciente de los depósitos de croro ne rolo realizó J.Spitz (12), el cual propone un nuevo baño e mpl<u>e</u> ando las siguientes condiciones de operación: $j = 120 \text{ nA/c r}^2$, a temperatura de 25[°]C con anodos de acero.

33 -

Con el fin de comparar la influencia del sustrato en las propiedades ópticas,Spitz (12) realizó experiencias cuyos resul tados se encuentran en la Tabla II.1.2

 Sustrato	α	20 ⁰ C	ε 80 ⁰ C	150 ⁰ C
 Niquel sobre Acero	0.96	0.13	0.16	0.20
Niquel sobre Cobre	0.99	0.14	0.18	0.22
Cobre	0.98	0.09	0.12	0.16

TABLA II, 1, 2

A estas muestras les corresponde un tiempo le depósito de 90 se ε. . Cabe señalar que los valores de α y ε fueron medidos a partir de reflectividades hemisféricas espectrales.

Otra for mulación para el depósito de cromo negro es aquella que tiene como característica (8) el uso de ácido acético como catalizador, bajo las siguientes condiciones de operación: j=7.5 A/d n² y una temperatura de 40^oC para un tiem po de electrolisis Θ_{nin} de 5 minutos en el cual se encuentran valores ópticos de α =0.91 y ε =0.079. La evaluación de dichas propiedades ópticas se efectuaron por netodos calorinetricos.

EVAPORACION AL VACIO.

La obtención de croro negro por evaporación al vacio (10) consiste en evaporar croro retálico en atrosferas reducidas de argón (0.5 y 3 Torr) sobre sustratos de cobre, e<u>s</u> ta evaporación se realiza con filamentos de tugsteno, en una camara previamente evacuada a 10^{-5} Torr, por un periodo de 20 a 30 minutos.

Los resultados obtenidos por Hardin (10) ponen en evidencia un parametro estraté fico que es el espesor-masa depositado, *o*.

En la Fig. II, 1.5 se representa a el espesor masa (σ) en función de α y ε . En dicha figura se observa que para $\sigma=20$ g/cm² los valores de α y ε encontrados son 0.8 y0.05 respectivamente.



Fig. II.1.5 α total(+)
 y ε (•) total en
 función del σ pa
 las capas prepa radas a 1/2 Torr.

. 34 -

El mismo autor realizó experiencias a presiones 4 mas elevadas (10 Torr), encontrando resultados similares, probablemente debido a la rapida oxidación de la superficie.

Comparando los dos metodos de depósito de cromo negro, observamos que el mas conveniente, económicamente es el electodepósito. Pero en ambos, las condiciones bajo las cuales se obtienen dichos depósitos no han sido completamente depuradas, evidenciandose la necesidad de optimizarlas.
II.2 Estructuras propuestas para el Crono Negro.

Una mejor comprensión de la estructura de los electrodepósitos de cromo negro, permitirá entender los fenórenos de absorción de la radiación electromagnética. De ahí el interes el conocer la distribución de los compuestos y/o el<u>e</u> mentos que conforman dichos electrodepósitos. Para este fin debemos de recurrir a un análisis de estos recubrimientos m<u>e</u> diante el empleo de técnicas coro la microscopia electronica de barrido,(SEM), espectroscopía de fotoemisión(ESCA), Rayos X,

Fan y Spura $\langle 22 \rangle$ su guirieron que el croro ne gro electrodepósitado puede ser representado por un rodelo de capas de interferencia. Dicho rodelo su guiere una distribución del 29% en voluren de Cr^o y el resto de Cr₂O₃. El espesor de dicho recubrimiento es de 650 Å, el cual se encuentra dividido en dos capas, una de 200 Å unida al sustrato y otra de 350 Å constituida principalmente por Cr₂O₃. Sin embargo este rodelo no puede reproducir valores mayores a 0.95 de absortividad

Con ayuda del microscopio de barrido electronico (SEM) Lampert (23) determinó que la morfologia del cromo negro so-co bre un sustrato de niquel, consiste en masas de pariculas con un diametro de 0.05-0.3 µm alternados con espacios vacios . El analisis de dichas particulas con la tócnica EDAX se detectó la presencia de cromo y niquel, no especificando de que tipo de cromo se trata ni su estructura que tiene. Median

- 36 -

te un bombardeo electonico de dichas muestras se observó un cambio al que denomino "incandecencia", el cual es un efecto tipico de los dielectricos, asi coro de algunos semiconductores.

Una vista de la sección transversal de estos depósitos se muestra en la Fig. II.2.1, la cual fue lograda con el micros copio electronico de transmisión (TEM).

Como resultado del empleo de estos dispositivos de an<u>a</u> lisis.Lampert, estableció que la estructura del cromo negro co<u>n</u> siste en masas de particulas de 0.05-0.3 µm de diametro y estan constituidas de particulas finas de cromo metálico con un dia<u>re</u> tro promedio de 139 Å, alrededor de los cuales se encuentran otras particulas de un material que puede ser una estructura amorfa o también un óxido extremadamente fino de cromo coro el Cr_2O_3 .

Estudios mas recientes efectuados por Spitz (12) con un analisis de difracción de rayos X, señala la existencia de dos fases cristalinas; una de ellas fue identificada como cro mo fcc con pararetros de red ligeramente diferentes a los valores teóricos, la otra fase es el hidruro de cromo hexagonal CrH_2 . El tamaño de dichos cristales es de 100 a 200 Å y fue determinado por lineas ensanchadas de rayos X. Después de un calentamiento en vacío de estas capas de cromo negro a 600°C durante tres horas, se encontró que el cromo negro fcc presen taba valores correctos de los parámetros de red y óxido de cromo Cr_2O_3 . Esto quiere decir que durante el calentamiento existe una descomposición del CrH₂ y una cristalización del -

- 37 -



Fig. II.2.1 Una sección de cromo negro sobre sustratos de Niquel mediante el empleo del microscopio de Transmision (TEM)



Fig. II.2.3 Cromo Negro en depósitos de Niquel como sustrato, logradas las vistas mediante el microscopio electronico de barrido (SEM)



oxido de crono.

Para determinar la naturaleza de los oxidos coro una función del espesor Spitz emplé espectroretria de fotoelectrones (ESCA). Para ello utilizó una radiación de excitación en la serie AlKα= 148.6 eV, ademas de realizar un bombardeo ionico en las muestras, con el fin de reducir su espesor.

39 -

El resultado de estas experiencias se puede resurir de la manera siguiente: la primera capa consiste en una mezcla de Cr_2O_3 y CrO_3 y tiene un espesor de 200 Å en la parte superficial. Bajo esta capa se encuentra otra con un espesor de 800 Å for mada por Cr_2O_3 y pequíñas trazas de Cr metálico. In mediatamente bajo esta (entre 1000 y 3000 Å), unida al sustrato apa rece otra capa de Cr_2O_3 y Cr metálico, au mentando la proporcion de este último conforme se acerca al sustrato. Graficamente podemos ilustrar dicho modelo como:



Fig. II.2.1 Representación del modelo de Spitz para la microestructura de los depósitos de cromo negro.

Sin embar go dicha distribución no esta acorde con la su gerida por Window, el cual postula que la capa 1 (Fig. II.2. 2) está compuesta de Cr₂O₃ y Cr metalico. Y solamente propone una se gunda capa constituida por Cr₂O₃.

Por otro lado A. Ignatiev (21) estableció un modelo so bre la microestructura que se presenta a continuación:

a) Una capa de 400 Å de espesor corpuesta por oxido de cromo en la parte superior, (Cr_2O_3).

b) Cercano a la capa anterior hay otras en las cuales principalrente se tiene Cr^{0} , con un diometro de 1000 Å.

Hay pequñas cantidades de Cr_2O_3 (del 10 al 15% conrespecto a la concentración de la capa superior) en el seno de esta capa y que probablemente se presenta coro un oxido muy fino sobre particulas de croro metalico. Las particulas de croro estan separadas por vacios, formando una capa porosa.

El empleo de altas resoluciones en un SEM de rostraron la formación de paquetes de particulas con un espesor de 400 Å Despues de un deterioro en estas capas mediante un borbardeo con iones argón inertes en dosis de 1 x 10⁷ iones/cm² a 1.5 -KeV se observó que la estructura superficial se conserva. Sin embargo con una dosis mayor (4 x 10¹⁷ iones/cm²), casi la to talidad del cromo negro se remueve, apareciendo, el sustrato -(niquel); esto ademas revela que por debajo de la capa fundamental (400 Å) se encuentra otra con paquetes de partícualas de cromo metálico de ≈ 1000 Å de diametro. Mediante el uso de la espectimetría de fotoemisión con rayos X se determinó la composición quimica de estas muestras, teniendose principalmente Cr_2O_3 y solamente de un 10 al 15% de cromo en estado metálico.

De lo anteriormente expuesto se observa que no existe aún una teoria unificada sobre la microestructura del cromo negro, la que es necesaria para proponer un modelo que nos ayude a entender la absorción de la radiación electromagnética en este tipo de superficies.

- 41 -

II.3 Hipótesis sobre el mecanismo de formación de los depósitos de cromo negro.

El depósito electrolítico de cromo negro ha sido utilizado con fines decorativos para producir capas negras o peliculas antireflejantes. Sin embargo el mecanismo de dicho depósito no está muy bien comprendido.

Originalmente el cromo negro se obtuvo por el tratamie<u>n</u> to de superficies cromadas brillantes con: cianuro de sodio, carbonato de sodio y soluciones de cloruro de sodio, a temperaturas mayores a los 800°C. Actualmente las técnicas consisten en la electrodeposición directa utilizando densidades de corrie<u>n</u> te de algun@s cientos de mA/cm².

Muchos de los baños electrolíticos utilizados para obtener dichos depósitos sugieren la adición de BaCO₃ con el fin de eliminar la presencia de _{iones} sulfatos

Se ha encontrado experimentalmente que un aumento en la concentración del catalizador trae como consecuencia la formación del cromo metálico. Esto ha sido confirmado con el trabajo de Sargent (15), quien reporta la presencia del ión SO_4^- en un baño de ácido crómico y establece su importancia en él. Ademas establece que existe la formación de una capa coloidal de productos de reducción del ácido crómico, incluyendo Cr(VI),Cr(III) y el ión SO_4^- . Esta capa coloidal es identificada como una "ca-

- 42 -

pa obscura", la cual crece a partir del cátodo con depósitos de cromo metálico, una vez que se interrumpe la corriente. Dicha capa es muy soluble en ácido cromico y sulfúrico.

Gerisner y Kappel (36) propusieron que el 16n $SO_4^{=}$ limita el espesor de la "capa obscura" e inhibe su crecimiento; el tlujo depositado - de cromo metálico aumenta al disminuir el desprendimiento de hidrogeno.

Sin embargo trabajos presentados por otros auores (26) demuestran La existencia de capas catódicas, tormadas en presencia y ausencia del ion $SO_{\mu}^{=}$.

Por otro lado, Sargent y Liebreich (15) encontraron que puede depositarse cromo metálico sobre el cátodo o sustrato a patir de un complejo Cr^{+3}/Cr^{+2} , el cual se favorece por la interacción del ión $SO_4^{=}$ con el - hidróxido de cromo.

La especie activa es el ión $HCr_{3}O_{10}$ y este, forma un tetrahedro - regular, mediante un enlace directo metal-oxígeno.

Dicha especie es suceptible a formarse de la siguiente manera:

Cro3 + 1120 - + Hz Croy Nz croy + Hz croy and Hz cr207 + Hz0

W2 Croy + H2 20, 2 H2 Cr30:0 + H20

En soluciones de ácido crómico diluido, el color indica el grado de polimerización. Asi tenemos que soluciones diluidas de 0.01M muestran un color amarillo lo que significa la presencia del ión $HCro_4^-$. El color naranja de la solucion se tiene a concentraciones de 0.1M, teniendose como especie activa al ión $HCr_2^{0}\overline{7}$ y para soluciones mas concentradas (1.0M) la existencia del ión $HCr_3^{0}\overline{10}$ el cual produce un color rojo.

Despues de adicionarle moleculas de agua, el cromato t<u>e</u> trahedrico se une formando polímeros con átomos de oxígeno en las esquinas del tetrahedro, siendo esta la especie activa en un baño de cromado. Dicho ión, debido a su carga negativa se e<u>n</u> cuentra cerca de la superficie del cátodo; produciendose una c<u>a</u> ida de potencial en la doble capa de Hemholtz, debido a la dif<u>e</u> rencia de concentraciones del ión entre la capa y el seno de la solucion.

El mecanismo propuesto por Hoare establece que existe una reducción del ión Cr(VI) al Cr(V) por la transferencia de un electrón del ión tricromato cercano al plano exterior de la doble capa. Esto se muestra en la ecuación siguiente(16):

A partir de este punto la reducción continua de Cr(V)a Cr(IV):

. 44 -



Y con la transetencia de un tercer electrón, y 1a perdida de --

oxigeno:

El anión O^{-} reacciona inmediatamente con el H⁺ formando H₂O. En la ecuación (3) el producto de la derecha, crómico-dicromato, es el material agregado a la capa catódica, y esta ha sido identificada como capa -"rompedorea" de Muller, capa coloidal ó la capa viscosa de Saiddington y Holy. Las uniones del Cr(III) en este complejo impiden la formación de un compuesto acuoso, el cual es uno de los requerimientos para el mecanismo posterior.

El producto crómico-dicromato en soluciones fuertemente ácidas puede reducirse a cromoso-dicromato por una nueva transferencia de electrón de la siguiente manera:



....(4)

Para la reacción, el producto cromoso-dicromato puede -

45 _

descomponerse por la reacción con H_{30}^+ de la siguiente forma:

- 0- er- 0- er- 0 = + H2 et - + H2 ez ez ez(5)

El producto de la derecha participa en la formación del cromo negro. Y apartir de este, sis se tiene la presencia de iones sulfatos en el baño puede entonces llegar a formarse cromo metálico. De la manera siguiente:

$$Cr(0h)_2 = Cr=0 + H_20$$
.....(6)

Debido a la presencia del ión $SO_4^{=}$ en medio icido, la especie - activa es el ión HSO_4^{-} , que al reaccionar con el Craso:

el producto de la derecha presenta la siguiente resonancia :

....(8)

naciendo un balance alrededor del plano de Hemnoltz, la carga positíva del complejo puede ser adsorbida sobre la superficie del cátodo con el desplazamiento de una molécula de agua con el sulfato tetrahedrico orientado nacia el seno de la solución. A partir de esta configuración el ión Cr(I) pasa a Cr^{0} por una nueva transferencia de electrón regenerandose el ión HSO_{4}^{-} , como se ilus tra:

$$C_{r-0} + \frac{1}{8} + \frac{1}$$

En resúmen, en el mecanismo, la formación del complejo cromo-dicromato es una etapa determinante debido a ello es necesaria la protección de este complejo, si se requieren depósitos de cromo negro, ya que en soluciones fuertemente ácidas se favorece la reducción hasta cromo metálico.

Por 10 tanto la tunción del ión HSO_4^- es la de ser un verdadero catalizador en los baños electrolíticos .

De 10 expuesto anteriormente se desprende que dicho ión (HSO_4^-) actua primero: como agente en la formación del complejo cromico-dicromato y después en la del complejo Cr-O-HSU₄, el cual interviene en la reducción del Cr(II) a Cr^O.

Griffin (19) menciona que además del ión $SO_4^{=}$ existen otros iones como F y $SiF_6^{=}$ que son puenos catalizadores en los baños de electrodepósito, entre 25 diferentes catalizadores ensayados por él.

Estudios realizados por ivanova (18) establecen que la concentración óptima de compuestos de fluor para depositar cromo negro sera menor a los 2 g/l, ya que concentraciones elev<u>a</u> das provocarian la reducción total a Cr^{0} .Estableciendo este autor, la formación de los ionos Cr^{+2} como los indispensables para electrodepositar este tipo de superficies.

Algunos otros catalizadores (12) como el ácido acético metavanadato de amonio, nitrato de sodio, urea, ácido fluorobórico como tambien el fluoruro de amonio han sido experimentados este ultimo con resultados no satisfactorios.

Tambien es posible interpretar la composición de los d<u>e</u> pósitos de cromo negro con la ayuda del diagrama tensión ys. pH de Pourbaix (Fig. II.3.2).

Como se puede vor en este diagrama la zona de estabilidad del ión $H_2CrO_4^-$ esta alrededor de 1.6 a 2 volts en soluciones fuertemente ácidas (pH=-1 y -2). Al aplicar una densidad de corriente catódica dicho ión sufrirá una reducción de Cr^{+6} a - Cr° , la cual esta en competencia con el desprendimiento de hidrógeno que se realiza sobre el sustrato. La aparición de $H_2^$ trae consigo un aumento del pH en la interfase electrodo/electrolíto que debe incrementarse a un valor de 4 o 5 para que se formen oxidos de cromo, tales como $Cr_2O_3 \gamma Cr(OH)_2$. Esto se ve confirmado por el mecanismo de Hoore en el cual se establece la formación de estos compuestos.

_ 48 _



•

CAPITULO III .

- 50 -

: `

E ::

EXPERIMENTACION

III.1 Estudio del baño propuesto.

En el desarrollo de un baño electrolítico con el fin de depositar cromo negro, tanto las variables del proceso de electrodepósito como la concentración óptima de los componentes de dicho baño influyen notablemente en los valores de los parámetros ópticos de esta superficie selectiva.

Las siguientes secciones están dedicadas al análisis de las condiciones de proceso y las concentraciones de los r<u>e</u> activos que forman el baño.

Con base en el baño propuesto por Window(24), se trató de tener las mismas condiciones, pero con otro tipo de reactivos(fluorosilicato de sodio en sustitición del ácido flu<u>o</u> ro silícico); eliminándose la sacarosa que definitivamente en nuestro caso impedía el depósito de cromo negro.

En base a estas condiciones y ensayando las concentraciones, se llego a la composición siguiente:

TABLA III.1.1

Cr03	400 g/1
BaCOz	7.0.g/1·
Na ₂ SìF ₆	1.14g/1

Trióxido de Cromo.

Se empleó una concentración de 400 g/1. El mecanismo que se siguió para la determinación de este valor fué el de experimentar con diferentes concentraciones, observándose que a concentraciones mas bajas que este valor, no se favorece la fo<u>r</u> mación de la especie activa necesaria en el electrodepósito. -Además de que los depósitos obtenidos no son homogéneos.

Carbonato de Bario.

El carbonato de bario es empleado para la precipitación de sulfatos. Como se observa en la Tabla III.1.1 la concentración mas adecuada es de 7.0 g/l. Experiencias a concentraciones menores dieron como resultado depósitos de cromo brillante, debido a que no se elimina completamente al ión SO_4^{-} . También se ha observado que el uso de concentraciones mayores a 20 g/l. de BaCO₃ produce precipitaciones de sales de cromo (), las cuales perjudican al baño.

Fluorosilicato de Sodio.

La concentración adecuada de este reactivo fué de 1.14 g/1. y dada su particular importancia se tratará en una sección posterior.

- 51 -

III,2 Condiciones de operación.

III.2.1 Densidad de corriente.

Entre los parametros que intervienen en el proceso de electrodepósito encontramos que la densidad de corriente es par ticulamente sensible, siendo muy pequeña la gama de densidades de corriente a las cuales se obtiene depósitos con buenas propi<u>e</u> dades ópticas.

Con el objeto de obtener la densidad de corriente adecuada, se trabajó con j = 350 mA/cm^2 , encontrándose que los dep pósitos presentaban estructuras muy rugosas y obscuras, además de que las variaciones de páso no seguian el comportamiento típico. Para disminuir la rugosidad, se optó por emplear densidades de corriente menores ($300,250,200 \text{ mA/cm}^2$) demostrándose que a medida que ésta disminuía, el comportamiento en el peso de dichos depósitos era semejante al patrón característico, como se discutirá en el Cap. IV.

Cuando se disminuye la j entre valores de 100-120 mA/ cm² la formación de color en los depósitos aparece lo que perjudica a los valores ópticos. El intervalo ideal encontrado es 150-250 mA/cm². Los depósitos obtenidos dentro de este intervalo resentan mayor homogeneidad, como se muestra en la Tabla III.2.1

- 52 -

- 53 -

TABLA III.2.1 350 mA/cm^2 Depósitos muy irregu lares y gruesos. 300 mA/cm^2 Acumulación de depósi to en los bordes de la placa. 250 mA/cm^2 Depósitos mas homogér neos pero con acumulación en los bordes de la placa. 200 mA/cm^2 Mas homogéneos y de buen aspecto. 150 mA/cm^2 Con aspecto de color ~ gris. 100 mA/cm^2 Francamente brillosos y el material no se depór sìta homogéneamente.

El voltaje aplicado a densidad de corriente de 200 mA $/cm^2$ fue alrededor de 4 volts.

En resúmen, la densidad de corriente es el parámetro principal que debe de optimizarse, pues de él depende el tipo de depósito que se forme, así tenemos que a valores altos de j dichos depósitos serán muy rugosos, en cambio a valores bajos, la cantidad depositada resulta ser muy fina. Un estudio del pe<u>r</u> fil de los depósitos será necesaria para confirmar este punto.

G

. 3

III.2.2 Temperatura.

Son dos las temperaturas a las que nos referiremos, la temperatura a la cual se realiza el electrodepósito (T_D) , y el incremento de temperatura (T_S) que resulta después de cierto tiempo de electrólisis.

La temperatura T_S perjudica al depósito y es por ello que debe de tenerse un control adecuado sobre ésta, ya que un. aumento en ella disminuye la eficiencia del depósito.

Con el fin de determinar un valor óptimo en $T_{\rm D}$, se hicieron variaciones sobre ésta, encontrándose que a $T_{\rm D}$ altas -(40[°]C) los depôsitos son muy irregulares, es decir, aparecen sobre la placa zonas en las que el material se aglomera, prefe rentemente hacia el centro de esta. En cambio a temperaturas bajas (23[°]C) los depósitos son mas homogeneos. Un resúmen de la influencia de la temperatura T_D se muestra en la tabla siguiente:

	TABLA III	TABLA 111.2.2.1		
T _D (^o C)		Aspecto del depósito.		
	40	Depósitos muy irregulares y amarillentos		
	30	Pocos homogén <u>e</u> os		

- 54 -

Э

cont. TABLA III.2.2.1

23 Buen aspecto mayor homogeneidad.

Se observô que a T_D cercanas a los 17^oC la apariencia mejoraba sustancialmente sin embargo T_S aumentaba, siendo mas difícil su control. Debido a que resulto más sencillo de contr<u>o</u> lar T_D a 23^oC fue entonces al valor seleccionado.

III.2.3 Concentración del catalizador.

Como reporta Spitz(12) la presencia de un catalizador y su concentración es determinante en la formación de un buen depósito. Así por ejemplo se observó que a concentraciones el<u>e</u> vadas (2 g/l.), se obtienen depósitos que presentan un aspecto brillante, presumiendose la formación de cromo metálico en pr<u>o</u> porciones mayores que la de los óxidos de cromo, y a la inversa si se tienen bajas conchétraciones (0.5 g/l.), se obtienen depósitos no homogéneos y con un color amarillento. De esto se observa que para estos dos valores extremos en las concentraciones, las curvas de peso vs. tiempo no son reproducibles. --Planteándose entonces la necesidad de estudiar la influencia del catalizador en un intervalo comprendido entre 0.5-2.0 g/l. Se efectuó este estudio encontrándose que la concentración óptima fué de 1.14 g/l. .

ి- 55 -

G

III.3 El sustrato y su tratamiento.

Como se ha mencionado anteriormente, el sustrato utilizado fue el cobre. Algunos autores(J1,12) efectúan un niquelado sobre dicho sustrato. Si se analiza la emisividad del Cu y Ni encontramos que siempre el Cu presenta una ε menor, lo que justifica su uso como sustrato. En cambio al niquelar al Cu aumentamos ésta emisividad, disminuyendo su potencialidad como sustra to, aunque esto le imprime una mayor adherencia a los depósitos de cromo negro.

Con el fin de observar el efecto que produce en la em<u>i</u> sividad un tratamiento de limpieza, antes y después de electrodepositar las placas de cobre, se hicieron las siguientes experiencias:

a) Sobre la placa cortada, se midió la ϵ (sin realizarle limpieza) y se encontró que esta tenfa un valor promedio de 0.06 después al depositarle cromo negro se volvió a medirla, siendo esta vez de 0.2(Con las mejores condiciones de trabajo).

b) Se efectuó un desengrase mediante tricloroetileno y acetona, midiendose posteriormente la ε que tuvo un valor de 0.05. Procediendo después a depositarlas, alcanzando esta vez un valor de 0.15.

c) Con el empleo de un desengrase y una limpieza electrolitica al sustrato con las siguientes técnicas:

c]) Un lijado con carburo de silicio de diferentes numer ros de grano(250, 400 y 600).

- 56 -

Э

Ö

c.2) Un electropulido con $H_3PO_4(12M)$ a una densidad de cocorriente de 163 mA/cm² con temperatura de 25^oC, utilizando ánodos de cobre, durante un tiempo de electrolisis de 3-4 min. Se encontro que la emisividad promedio del sustrato después de dicha limpieza fue de 0.03. A partir de lo cual se procedio a electrodepositarla, logrândose un valor de ε en 0.1.

El inconveniente encontrado con este método fué la rápida oxidación que se presenta en la placa al término de la limpieza.

d) Mediante una pulidora mecánica y el uso de una pasta de pulido se trataron algunas placas de cobre hasta imprimirle una apariencia de "espejo", de esta forma el ε era de 0.01, electr<u>o</u> depositándose posteriormente. Resultando un depósito muy bri-llante con valores de ε = 0.07, pero con el inconveniente de que el valor de $\dot{\alpha}$ es 0.6, debido a lo cual se desechó el método.

El control sobre una área bien definida es necesario, ya que al variar ésta, el parametro j cambiará, bajando entonces la eficiencia del depósito. Con el fin de controlar esta área, se procedió a ensayar diferentes materiales que recubri<u>e</u> sen la parte posterior de la placa, tales como el poliéster, acrílico, silicón, etc. dando como resultado el atque de estos con la solución crómica. Sin embargo el empleo de la resina epoxica MPT-8011 (29) resultó ser la mas conveniente.

- 57 -

3

III.4 Relación ánodo/cátodo.

Э

Se utilizó como ánodo al plomo cuya área debe de ser mayor que la del cátodo formando estos dos valores de área -una relación denominada relación ánodo/cátodo.

- 58 -

Se ha observado que a relaciones altas la acumulación de depósito en los bordes del sustrato se hace presente. En cambio a bajas relaciones la formación de capas blanquigcas y amarillentas se presenta.

III.5 Distancia entre electrodos.

La resistencia que se crea al aplicar una corriente a cualquier baño electrolítico es debida a la separación que existe entre ánodo y cátodo. Con el fin de cuantificar dicha separación se realizarón pruebas a diferentes distancias, observándose que a medida que esta separación se incrementa se obtienen placas no homogéneas y a la inversa, al disminuirla aparecierón depósitos obscuros. La separación ideal se encuentra a 4 cm., (para una área de ánodo de 46.8 cm² y 36 cm² para el cátodo.

III.6 Relación CrO3/Na2SiF6.

La relación CrO_3/Na_2SiF_6 es un parámetro que nos indica las proporciones en peso de CrO_3 al Na_2SiF_6 empleadas y que es muy frecuentemente utilizada para indicar la eficiencia de un buen cromado.

La Tabla II	I.6.1 mue	stra 1	as dìf	erente	s relad	ciones e <u>x</u>
perimentadas.	TAB	LA ITI	.6.1	 	• • • · · · · · ·
Compuesto/Baño #	1			4	.5.W	indow
Na ₂ SiF ₆ (g/1).	0.048	0.65	0.97	1.14	1.37	
SiF	0.036	0.49	0.74	0.86	1.03	0,378
Cr0 ₃ /SiF ₆	100					

En nuestro caso la mejor relación fue de 100/0.21. Bajo la cual la apariencia de los depósitos resulta mas homogênea

III.7 Medición de propiedades ópticas.

Las medidas de α y ε en nuestras muestras se efectuaron en un alfatómetro modelo 1A para la α y un emisómetro modelo AE para ε . Dichas medidas se encuentran clasificadas en la sección llamada Metodos Opticos(Cap. II).

El alfatómetro (Fig.III.7.1) consiste en una termopila miniaturizada tipo piranómetro, su detector de radiaciones es una termopila con 32 uniones negras y blancas. Las negras son placas con pintura negra y las blancas estan ahumadas con óxido de magnesio. Esta combinación en el detector nos asegura una -

- 59 -

C

ß

respuesta aproximadamente constante a la radiación en un gama de longitudes de onda que va desde 0.3 a 2 µm.

Para obtener la absortividad es necesario medir la reflectividad, es decir la relación de energía que se refleja a la que incide en una superficie, para ello se cuenta con un voltmetro, que nos dará una medida de dicha energía,

> Así tenemos que la reflectividad se mide: $\rho \stackrel{\checkmark}{=} \frac{\text{Energia reflejada (volts.)}}{\text{Energia incidida (volts.)}}$

y la α se puede calcular de la manera siguiente:

 $\alpha = 1.0 - \rho$

En el emisometro (Fig. III.7.2) se encuentra un detector que es una termopila diferencial. La respuesta de este detector es solamente a la transferencia de calor por radiación y esta diseñado para dar un voltaje de salida que es lineal con la emisividad. La emisividad de una superficie puede determina<u>r</u> se despues de haber calibrado al detector con una muestra de emisividad conocida, la cual se mantiene a la misma temperatura que la desconocida. Esta superficie de ε conocida esta constit<u>u</u>, ida por un par de placas, una de aluminio y la otra con pintura negra. Esta combinación asegura una respuesta constante e<u>n</u> tre las siguientes longitudes de onda, de 3 a 30 µm.

La emisividad de una muestra desconocida puede medirse de la siguiente forma:

 $\varepsilon = \frac{\text{Volts-Muestra}}{\text{Volts-Placa Negra}} \times 0.93$

ξ.

n









- 62 -

CAPITULO IV

RESULTADOS

IV.1 Influencia de los parámetros de proceso en α y ε .

Para este baño en particular, como se ha indicado, nues tro principal objetivo es el de obtener y reproducir una superficie selectiva de cromo negro con propiedades ópticas aceptables - $(\alpha = 0.9 \ y \ \epsilon = 0.1)$!

Un fenômeno de partícular importancia a considerar es la variación del peso como función del tiempo de electrolisis que presentan diferentes baños electrolíticos, e indica esto una cara<u>c</u> terística de los electrodepósitos. Dicha variación se ilustra en la figura siguiente:



Fig.IV.1.1 Variación del peso ω en función del tiempo de electrolisis Θ

Como se observa existe una disminución del peso entre $\Theta_{max} \ y \ \Theta_{min}$. Este fenómeno hasta el momento no ha sido bien com prendido. Sin embargo el conocimiento de esta curva permite d<u>e</u> terminar el mejor intervalo de operación. Diferentes autores -(11,12) han encontrado que los mejores parámetros ópticos se en cuentran a un tiempo de electrolisis 0_{min}.

Densidad de corriente,

La Fig. IV. 1.2 muestra la variación del peso ω con respecto al tiempo de electrólisis θ , cuando la densidad de corriente se mantiene constante. Las diferentes curvas que se muestran corresponden a j, que se varió desde 140 a 350 mA/cm² (algunas curvas de j se muestran en esta Fig.). Como se puede observar a densidades de corriente altas (300 mA/cm²) las pendientes de las curvas evolucionan mas lentamente, en comparación - con j bajas e intermedias (Fig. IV.1.2 curvas d y c). Además a densidades de corriente bajas el comportamiento del peso con - respecto al tiempo es reproducible(ver Fig. IV.1.3 y IV.1.4).

Las variaciones de j con respecto a θ_{\min} y ω_{\min} se mues tran en la Fig. IV.1.5(a y b) manteniendo una concentración de catalizador fija. De la gráica IV.1.5 (b) se observa un máximo de ω_{\min} a una j = 180 mA/cm². Esto indica un cambio en el meca nismo de electrodepósito, observandose cualitativamente en las tonalidades de la placa, es decir que a j (<180 mA/cm²) bajas obtenemos placas blanquiscas pero a j altas (>180 mA/cm²) los depósitos son mas obscuros.

Temperatura

La temperatura de electrodepôsito (T_D) , mencionada en la seccion III.1.3, fué la que se sometió a variación, encontrandose que a T_D altas (40°C), las pendientes de las gráficas de peso vs. tiempo fueron bajas en comparación con las curvas

3

 \mathcal{O}



V.





. . .

?n

típicas para estos procesos. Debido a ello se disminuyó la tem peratura a 30° C, con resultados similares. Finalmente se encon tró que trabajando a T_D igual a 23° C, el comportamiento de las curvas peso vs. tiempo es similar al reportado en las Figs. c<u>a</u> racterísticas.

Concentración de catalizador.

En la tabla IV.1.1 se encuentran los valores de θ_{min} y ω_{min} a diferentes concentraciones de Na₂SiF₆, obtenidos de nue<u>s</u> tras primeras experiencias.

En base a los resultados obtenidos en las variaciones de los parámetros de proceso, se puede sugerir el empleo de los siguientes valores:

> Densidad de corriente - 180 mA/cm² Temp. de electrolisis - $23^{\circ}C$ Conc. de Na₂SiF₆ - 1.14 g/1.

IV.2 Variación de α y ε como función de j y Θ .

Con las condiciones de electrodepósito mencionadas en la sección anterior, se elaboraron las muestras que fueron objeto de caracterización óptica. Las Figs. IV.2.1(a,b,c,d,e y f) muestran la variación de α y ε como función del tiempo de electrólisis 0. En dichas Figs. se observa que para un intervalo de 0 (0~180 seg.) la evolución en las propiedades ópticas es mas ~ lenta a j bajas (140 mA/cm²) que a valores altos de j (190 mA/cm²)





*

TABLA IV.1.1

Na ₂ SiF ₆		^w min	ф	j (mA/cm ²)
0.65	180	0,2	36	140
0.90	156	0.35	54.6	TT
0.98	160	0.30	48	11
1.14	150	0.40	60	11
1.37	120	0.55	67.6	**
0.65	150	0,90	135	180
0.90	108	1,24	133,9	f f
0.98	90	1,26	113,4	11
1.14	80	1,76	140.8	11
1.37	60	1.80	108.0	11
0.65	120	0,90	108	250
0.90	99	1.10	108.9	11
0,98	90	1.26	113.4	11
1.14	. 78	1,50	117,0	11.
1.37	60	1.90	114.0	**
0.65	90	0.48	43,2	350
0,90	.70	0.47	32,9	13
0.97	- 60	0.46	27,6	ŦŦ
1.14	57	1.59	90,63	11
1.37	48	1.70	81,6	tt

Las Figs. IV.2.2(a,b y c) muestra la variación de α y ε con respecto a la densidad de corriente, para un tiempo de electrólisis fijo Θ . Comparando la Fig.IV.2.2(a) y la (c), vemos que la curva de emisividad para los 90 seg. la pendiente aumenta drásticamente en comparación con la curva a los 30 seg.



Fig. IV.2.1 (a,b,c) Variación de α y ϵ como función de la densidad de corriente, -

para un tiempo de electrólisis fijo 0

71 -

C
Esto puede ser explicado por una posible disminución de las partículas de cromo metálico y un aumento en la formación de oxidos de cromo.

72 -

.3

Por otro lado, si observamos la evolución de las pendientes en las curvas de absortividad para la correspondiente a 90 seg., esta es más rápida que a los 30 seg. Esto es explicable ya que las muestras electrodepósitadas a 90 seg. son más obscuras que las preparadas a los 30 seg.

En cambio a los 60 seg. la curva (b) Fig. IV.2.2,105 valores de α y ε presentan pendientes intermedias entre los \neg dos tiempos anteriores(curvas (a) y (c)), lo que nos proporciona una superficie con parâmetros ópticos a las de una superficie selectiva ideal. Sin embargo estos valores no se obtivieron a j = 180 mA/cm², indicada como la óptima, sino a valores mas bajos (160-170 mA/cm²), sugiriendo con esto que los mejores valores de α y ε no se presentan en Θ_{min} como lo mencionan algunos autores(11,12) y que de nuestras experiencias observamos que los mejores parâmetros ópticos están entre Θ_{max} y Θ_{min} (ver Fig. IV.1, 1).

Influencia de la concentración del catalizador en α y ϵ .

Un intervalo óptimo se tiene entre 1 a 1.2 g/l, para α altas y ε bajos con una j = 170 mA/cm². Para fijar un valor de la concentración de Na₂SiF₆ óptimo se introdujo un parametro ϕ que resulta de multiplicar ω_{\min} por Θ_{\min} para cada j. En 1a - Fig.IV.2.3 se observa la gráfica de ϕ como función de la concentración del catalizador, indicándose en esta un ϕ_{\min} . Esto indicó la presencia de dos fenómenos opuestos, uno es la tendencia de Θ_{\min} a disminuir marcadamente al incrementar la cantidad de catalizador(ver Fig. IV.2.4) y el otro el de aumentar rápidamente la cantidad de ω_{\min} con la concentración del catalizador, dando como resultado un punto particular que denomin<u>a</u> mos ϕ_{\min} (ver Fig. IV.2.3).

El valor del parámetro ϕ_{\min} presenta valores más altos a intensidades de corriente j = 180 mA/cm² y al incrementar j, ϕ_{\min} presenta valores pequeños. De donde se tiene que en el parametro ϕ influyen más los valores de Θ_{\min} que la cantidad depositada ω_{\min} .



Fig. IV.2.3 Variación de ϕ como función de la concentración del catalizador a densidad de corrie<u>n</u> constante (curva 1 - 140 mA/cm²) (" " 2 - 180 " ") (" " 3 - 250 " ")

- 73 -

Э



FIG. IV. 2.4 (a Y b). VARIACION DE EL TIEMPO MINIMO θ min (a) Y EL PESO MINIMO ω min (b) EN FUNCION DE LA DEN-SIDAD DE CORRIENTE





 \sim

CONCLUSIONES.

76 -

De acuerdo a los estudios encontrados en la literatura, el cromo negro electrodepositado es uno de los recubrimie<u>n</u> tos que se ha utilizado con mayor frecuáncia para las aplicaciones en la energía solar, ya que presenta su escalón espectral alrededor de 2 μ m, lo cual permite que su coeficiente de absorción α sea cercano a 0.9.

Los parámetros de obtención son los que determinan las propiedades ópticas del electrodepósito.

En el presente estudio se reportan las composiciones y las condiciones de operación óptima. Encontrandose que el tiempo de electrolisis es el factor predominante .

El mejor compromiso optico ($\alpha = 0.92$ y $\varepsilon = 0.08$) se ha encontrado cuando se aplica una densidad de corriente de -170 mA/cm² para un tiempo de electrolisis θ de 60 seg. con una concentración de catalizador de 1.142 g/l. Por lo tanto los d<u>e</u> pósitos obtenidos, bajos las condiciones anteriores, son suce<u>p</u> tibles a ser utilizados como superficies selectivas.

BIBLIOGRAFIA.

- D.M. Trotter, H.G. Craighead y A.J. Sievers
 "Design of selective surfaces for solar collection" Solar Energy Materials, Vol.1; No.1,2 Feb. 1979.
- (2) Tabor H. " Selective Radiation", Bull Reseach Concil, Israel 5A(2), 129,134; 1956.
- (3) Warren R.N. "Solar Selective Surface made of semiconduct powders", The American Society of Mechanical Eng. United Eng. Center.
- B.O. Serphin "Spectral Selective Surface", Edits. D.E. Dixon, J.D. Lesslle, Solar Ener gy Convertion an introductory course.
 Pergamon Press, Agust. 6-19, 1978.
- (5) Duffie and Beckman, Solar Energy Thermal Processes, Wiley-Interscience Publication, 1a. edición, 1974.
- (6) D.R. Mc Kenzie, J.Opt. Soc. Am. Vol. 66, pp. 249, 1976.
- (7) Aden B. Meinel and Marjorie P. Meinel, Applied Solar Energy and Introducction, Adison-Wesley Publ. Co., 2a. edición, Jan. 1977.
- Julia Quintana L1. "Estudio y desarrollo de superficies selectivas para el aprovechami de la Energia Solar". Tesis profesional, Fac. de Quimica, 1976.
- (9) Glen E. Mc. Donald, "Spectral Reflectance Properties for use as solar selective coating.",

- 77 -

Solar Energy, Vol.17, No. 2.

- (10) G.L. Harding, "Evaporated Chromium Black Selective Solar Absorbers", Thin Solid, 38, (1976), pp. 109-115.
- (11) B.Window y I.T. Ritchie, "Selective Electroplated Chomium Black", Applied Optics, Vol. 17, No.16, 1978.
- (12) J.Spitz, Tran Van Danh y A.Aubert, "Chromium black coating for photothermal conversion of solar energy" part I (Preparation and Structural Characterization, Solar Energy Mat. -Vol.1 (1979) 189-200.
- (13) J.M. Behaghel, S. Berthier, J.Lafait y J.Rivory, "Chomium Black for photothermal conversion or solar energy, part. II Optical Propieties" Solar Energy Mat. Vol.1 (1979), pp.201-213.
- (14) M.G. Hutchins, Solar energy unit, University college Cardiff, " Current advences in the develoment of electrodeposited black chrome solar absorber coating"
- (15) G.J. Sargent, Trnas. Am. Electrochemical Soc.,Vol. 37, pp. 479, (1920).
- (16) Hoore P.J., J.Electrochemical Soc."Electrochemical Science and Technology", Vol. 126, No2.
- (17) A.V. Pamfilov and A.I. Lapushanskaya, Ukr. -Kim J. 26,46(1960):Chem. Abs. 55,8916h(1961).

- 78 -





3

- (18) Ivanova N.D., Kladnistskaya, Chemical Abs. Vol. 81, 1974.
- (19) J.L. Griffin, Plating Vol.53, pp.196 (1966).
- Y. Meas, G. Poillerat," Unas ideas sobre el mecanismo de electrodepósito del cromo negro", II Congeso Nacional de Electroquímica, 13-14 de Nov. Mexico D.F. 1980.
- (21) A. Ignatiev, P.O'Neill "Micoestruture of Chrome Black" Solar Energy Mat. Part.I pp.69-79 (1979)
- (23) Lambert M.C. and Washburn, Solar Energy Mat. Vol.1, (1979) 81-92.
- (24) R.E. Hahn, B.O. Seraphin, In Phys Thin Films Vol.10, ed. by G. Hans (Acdmy. Press, N.York 1978).
- (25) B.O. Seraphin "Topics in apllied Physics" Vol.31
 "Solar energy conversion solid-state physics aspects", pp.5-53(1979)
- (26) A.T. Vagramyan y D.N. Usachev , Zh.Fiz Khin 36 752,(1962).

(27) Y. Meas,L.Del Castillo, A. Fernández, "Electrodepositación del cromo negro, parametros que influyen sobre las propiedades ópticas del depósito" V Reunion Latinoamericana de Electroquimica y Corrosión, Concepción, Rep. de Chile, 29 Sept.-3 Oct., 1980.

- (28) Devices and Services Co. Emisometer Mod. AE1 y alfatometer 1A.
- (29) Especialidades epxicas e industriales S.A.

- (30) J. C. Richmond, "Measurement of thermal radiayion propieties of solids", A Symposium Held at Dayton Ohio, Sept. 5.6.7. (1963) NASA.
- (31) Gordon G.D. "Measurement of Ratio of absortivity of sunlight to themal emisivity" Rev. Sec. Instr. Vol.31,No.11, Nov. 1960, pp.1104-1204.
- (32) Buttler C.P. and Inn E.C.V. " The total hemisferi cal emeisitvity of metals", U.S. Naval Radiolo-

gical Defense Lab. Tech. Rep. USNRDL-TR-327 May 1959.

- (33) Hernández E. "On the numerical computation of Solar radiation parameters from Satelite cloud coverd data" Proceedings of the UNESCO/Wold Meteorological Organitation-Solar energy Sym. Ginebre Suiza, 1976.
- (34) Hernández E. "The Seasonal distribution of the incoming solar radiation in México", Proceedings of the Sharing the Sun 76 solar technology, International soalr energy Soc., Winnipeg, Canada, Vol. 10, 1976.
- (35) D.M. Mattox et. al. Sandia Lab. Alburquerque, -New Mexico, SAND 75-0361, Jul.(1975).
- (36) H. Gerischer and M. Kappel, Z. Phys. Chem. N.F.
 8, 258(1956); Z. Elektrochem., 61, 463(1957); 64
 235,(1960).